Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0401U002695

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 16-10-2001

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Романюк Андрій Борисович
2. Romanyuk Andrij Borysovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.07

Назва наукової спеціальності: Фізика твердого тіла

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 28-09-2001

Спеціальність за освітою: 7.070201

Місце роботи здобувача: Інститут фізики напівпровідників

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: 03028, Київ, Україна, проспект Науки 45

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К.26.199.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізики напівпровідників

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: 03028, Київ, Україна, проспект Науки 45

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.21, 29.19.31, 29.31.21

Тема дисертації:

1. Властивості модифікованих вуглецевих плівок та шаруватих структур на основі кремнію
2. Properties of modified carbon films and Si-based layered structures

Реферат:

1. Досліджено властивості алмазоподібних та алмазних плівок, шаруватих структур на основі кремнію та механізми їх модифікації під дією різних обробок. Встановлено механізм збільшення твердості алмазоподібних плівок при високодозовій імплантації йонів азоту. Вперше низькотемпературним методом піролізу з використанням надзвукового плазмового потоку синтезовано алмазні плівки на підкладинках Si та досліджено їх властивості. Досліджено процес йонно-імплантаційного формування кремнійової шаруватої структури з прихованим шаром SiC та запропоновано механізм стимулюючої дії домішки кисню. Запропоновано нові типи гетерів для кремнію та проаналізовано механізми їх дії. Продемонстровано практичне застосування отриманих результатів на прикладі сонячних елементів.

2. Properties of diamond-like and diamond films, Si-based layered structures, and mechanisms of the film modification under action of different treatments were studied. The mechanisms of hardness drastic increasing for the films subjected to high-dose nitrogen implantation has been established. For the first time using low-temperature supersonic arcjet method diamond films on Si substrates are synthesied. The process of ion-beam

induced formation of Si layered structures with a buried SiC layer was investigated and the mechanism of oxygen-stimulated effect has been proposed. New getters for silicon were proposed and the mechanisms of their action were analysed. Practical application of the results obtained have been demonstrated for silicon solar cells.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Клюй Микола Іванович
2. Клюй Микола Іванович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бабич Вілік Максимович
2. Бабич Вілік Максимович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мельник Павло Вікентійович
2. Мельник Павло Вікентійович

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.04

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Шейнкман Моісей Ківович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Шейнкман Моісей Ківович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

Юрченко Т.А.